# 综合物理实验 (MgB<sub>2</sub>超导体的研究)(教案)

## 实验的目的要求:

- 1. 对于参与制备 MgB2 块材超导样品的学生,学会用固态反应法制备 MgB2 块材超导样品并掌握其主要性能的测试。
- 2. 对于参与制备 MgB2 超导膜样品的学生,学会用混合物理化学气相沉积法(hybrid physical-chemical vapor deposition 简称为 HPCVD)制备 MgB2 超导膜的方法,制备出合格的膜,并测量其基本超导性能。
- 3. 对于参加 MgB2 超导样品的学生都要学习了解样品的以下几个性能的测试: 反应超导转变温度的低温 R-T 曲线测量;根据样品的抗磁性所反应的样品超导转变温度的 M-T 曲线测量;可以确定样品在不同温度下的临界电流密度的 M-H 曲线;反映样品结构的 X 光衍射图谱;能够反映样品的表面形貌的扫描电镜图像 SEM 图等等。
- 4. 对于参与制备 MgB<sub>2</sub>超导块材和膜样品的学生都要自己动手测量样品的 X 光衍射图谱; 学生自己动手用扫描电子显微镜观察样品并获取样品的 SEM 图; 对于美国进口的物理性能测量系统 (physical properties measurement system, 简称为 PPMS) 和磁性测量系统 (magnetism properties measurement system, 简称为 MPMS) 要求知道它们的使用初步知识。对于 PPMS 测量主要了解样品的制备,要学习如何为样品粘接测量引线。对于 MPMS 设备要了解关于由 M-H 曲线计算样品的临界电流密度的基本道理。

## 教学内容:

(一) MgB2 块材超导样品的研究

- 1) 根据 MgB2 的分子式和实验要求的样品质量,按名义成份配比称出所需质量的原料镁粉和 硼粉。如果要进行掺杂方面的研究,例如制备 Mg1-xMxB2-yNy (M 是部分替代 Mg 的掺杂元素;,N 是部分替代硼的掺杂元素),同时也要称出掺杂原料的相应质量。
- 2) 将称出的镁粉、硼粉和掺杂原料粉沫放入玛瑙研钵中,用研锤将它们经充分研磨达到均匀混合,研磨至少进行 20 分钟。
- 3) 用可拆卸磨具将均匀混合的粉料用压片机压成长方形 MgB2 胚体样品。样品的厚度根据测量用的样品的要求决定。
- 4) 压片机使用时注意压力通常最高取为其最大压力值的 80%。例如我们实验室的压片机的 量程是 30 吨,通常使用时最大压力不宜超过 24 吨。
- 5) 使用磨具时要注意磨具芯要处于垂直状态,绝对不能偏离垂直方向。否则会造成磨具因 磨芯与其之间受力不匀致使磨具迸裂,造成人身危险。为避免因故磨具迸裂造成危险, 在开始压形之前一定要先放下压机上的保护罩。之后再行压样品。
- 6) 如果对样品是进行真空条件下的烧结,则必须首先将样品封入尺寸是长度是 20 厘米直径 是 2 厘米的抽了真空的石英管中,根据要求选择合适的温度进行烧结。样品封入抽了真空的石英管是请玻璃工师傅协助完成的。
- 7) 如果是进行惰性气体条件下的烧结,则首先将样品放入长度是约一米,直径是约 4 到 5 厘米的可抽真空的石英管中,在室温下将烧结样品的石英管密封好,用机械泵将之抽真空到粗真空(几十 Pa 到 100Pa),再充入惰性气体,使石英管内的压强约为 90KPa。如果是流动惰性气体烧结,石英管内气体压强可以达到 1 个大气压;如果是静态惰性气体烧结,则平衡气囊内的压强必须小于一个大气压。为保证样品烧结时,样品处于电炉子的中央恒温区,烧结电炉用可开启式电炉。
- 8) 气路内的气体稳定后,设定烧结程序,启动电炉对样品进行烧结。

- 9) 对烧结好的样品进行相关性能的测量。
- 10) 带样品到 X 光衍射实验室, 学习 X 光机的使用, 自己动手对样品进行一般测量。此时样品可以是片状的, 但是被测表面必须是平的。如果要求出样品的晶格常数, 则需取部分样品将之磨成粉末进行测量。试想一下, 对于粉末样品可以用较大的力去压样品吗? 为什么?
- 11) 带样品到电镜室用环境扫描电子显微镜观测样品的形貌像。观测时要获不同放大倍数的样品形貌像,以资对比讨论。如果是系列样品,则需取相同的放大倍数的形貌像图像,以资比较讨论。若欲获取样品断面的形貌像,应该用最新鲜的断面。
- 13) 用 MPMS 设备获取样品的 M-T 和 M-H 曲线。
- 14) PPMS 设备获取样品的 R-T 曲线。
- 15) 根据上述测量数据,决定是否对样品进行进一步的测量。

#### (二) MgB2 薄膜超导样品的研究

- 1) 熟悉 HPCVD 制备 MgB2 的实验装置,并能自己独立画出实验装置的原理图。同时还必须通过学习,熟悉具有毒性气体乙硼烷(B2H6)的基本性能和使用方法。
- 2) 在导师指导下,或在硕士生和博士生的指导下,通过2到3次的制膜过程的观摩,熟悉使用仪器的操作步骤,并将操作步骤用文字记载下来,以备自己独立操作时使用。
- 3) 在经老师考察允许后,学生方可以自己独立动手操作 HPCVD 设备。
- 4) 选择适当的衬底,用 HPCVD 设备独立制备 MgB2 超导膜。
- 5)如果在金属衬底上生长 MgB2 超导膜,首先要对衬底进行处理和清洗。处理包括首先用适 当型号的砂纸或砂布打磨样品表面,或则是对衬底表面进行抛光;其次用超声波清洗机 清洗衬底表面;第三用丙酮清洗衬底,之后再用无水乙醇清洗衬底。
- 6) 原料镁用镁条。先用钢锯条的锯背将镁条(直径是 6 毫米)上的氧化镁刮掉,再用大克丝钳从镁条上切下四小段镁条(每段长约 6-8 毫米)。
- 7)将衬底放在样品台的中央处,再将镁条放在样品台的四个槽内。小心地将样品台放入反应室内。
- 8)将样品室帽(连接有各种进气管路)通过螺纹连接器与反应室连接好。
- 9) 启动机械泵对系统抽真空到 100Pa 以下。
- 10) 启动交流感应电源对样品台加热至所需的温度,再接通乙硼烷气路,开始沉积 MgB2 超导膜。
- 11) 对制备好的膜进行基本物理性能测试。
- 12) 同(一)的10)到15)步骤对MgB2超导膜进行测量。

#### 实验过程中可能涉及的问题:

- 1. MgB2 是一种什么样的超导材料,它与传统的低温超导材料,例如 NbTi, Nb3Sn 有什么不同之处,有甚么相同之处?它与高温超导体有什么不同之处?学生通过自学和与教师或与研究声讨论加以明确。
- 2. MgB2 超导材料的应用前景。人们为什么认为 MgB2 这种超导材料能够在几年之内走向应用,这因为 MgB2 的相干长度大于氧化物高温超导材料的。
- 3. 如何提高 MgB2 超导材料的载流能力与上临界磁场 Hc2? 掺碳及增加样品内部的缺陷。
- 4. 缺陷是怎么产生的?缺陷有几类?
- 5. MgB2 超导膜是如何形成的? 为什么有的衬底上长膜容易有的衬底上长膜困难?

- 6. 镁是一种活性和高的金属材料。当有氢气和氧气共同存在的条件下,加热镁到 650℃时, 氧是先和镁反应生成 MgO,而不是氧气和氢气先反应生成水。因此只要反应器中有微量 的氧气存在,尽管有大量的氢气作为背景气体存在,生成的 MgB2 超导膜中会有微量的 MgO 作为杂相出现在膜中。
- 7. 如果相让镁与衬底处于不同温度,在实验装置基本不改变的条件下,你有什么办法?
- 8. 考虑一下,有哪些因素会影响 MgB2 超导膜的生长?
- 9. 纳米颗粒的尺寸范围是多大?
- 10. 纳米颗粒与普通颗粒在力学、热学、电磁学、表面活性和结构上的主要区别是什么?
- 11. 你能利用纳米材料的特点来解释用 HPCVD 法制备的不锈钢衬底 MgB2 超导膜在以 0.3 毫米的曲率半径弯折 180 度后, 膜面仍然紧紧地粘在衬底表面不脱落, 而且其超导电性可以保持不变?

12.

### 可进一步探索的问题:

1. 如果想测量 MgB2 的低温热导率,你应该如何准备样品?